

クロージング：シンポジウム閉会にあたって

Closing remarks: Progress of semiconductor wet processing - from silicon to compound -

関東化学 吉田 勇喜

KANTO CHEMICAL CO., INC. Yuki Yoshida

E-mail: yoshida-yuki@gms.kanto.co.jp

本シンポジウムは界面ナノ電子化学研究会が企画するもので、今回は半導体ウェットプロセスに関してシリコンに偏ることなく化合物半導体も含めたウェットプロセスに視野を広げ議論し、幅広い半導体材料の技術開発へつなげる場を形成する目的で開催した。今回の講演を踏まえて、シンポジウムの最後にディスカッションを行いたい。